

ナノインデンテーション ワークショップ

会場：日本電子株式会社 昭島本社

8/24
(金)

このたび、日本電子株式会社とブルカー・ジャパン株式会社ナノ表面計測事業部は、共同主催にて「ナノインデンテーションワークショップ」を開催致します。当日はナノインデンテーション評価技術に幅広い見識を持つ講師の方々をお招きし、ナノインデンテーション技術を用いた研究をご紹介いただくほか、最新トレンドのご紹介を致します。みなさまのご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております

概要

日時：2018年8月24日(金) 13:00-17:00 (12:30受付開始)

会場：日本電子株式会社 昭島本社

(<https://www.jeol.co.jp/corporate/outline/map/>)

〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2

(JR 青梅(おうめ)線 中神(なかがみ)駅 北口より
徒歩約10分、立川駅 北口よりタクシーで約15分)

定員：30名

費用：無料(事前登録制)

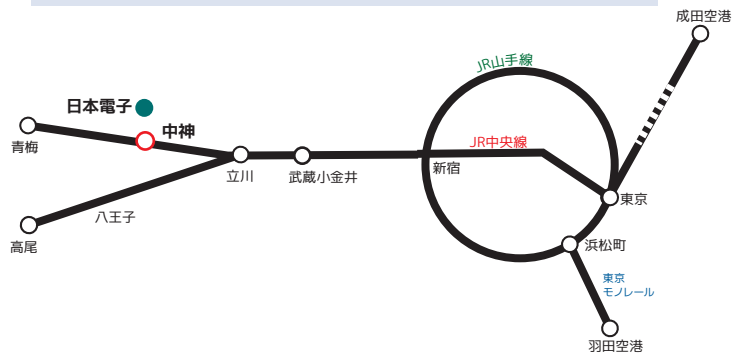


会場 MAP QR コード ▶

路線図

東京駅よりJR中央線快速電車で立川まで約1時間、立川駅始発のJR青梅線に乗り換え、3つ目の中神駅まで約10分です。

中央線快速青梅行き、中央線青梅特快は立川で乗換え無しで中神駅に到着します。



プログラム

※内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

13:00~13:15 開会のご挨拶

13:15~13:45「ハイジトロン ピコインデンターのご紹介」

13:45~14:15 [特別講演]

「金属材料におけるその場観察の動向と展開」

国立研究開発法人物質・材料研究機構

構造材料研究拠点 解析・評価分野 構造材料組織解析技術グループ 主幹研究員 井 誠一郎 様

14:15~14:45[特別講演]

「PI-95 TEMインデンテーションシステムによる材料組織と力学的応答の解析」

東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構 結晶界面工学研究室

栃木栄太 様

14:45~15:15 「透過型電子顕微鏡の紹介」

15:15~15:30 休憩

15:30~16:30 装置デモンストレーション & 質疑応答

ブルカー・ジャパン(株)ナノ表面計測事業部

日本電子株式会社

